

## 6. 4 企業参画型研究開発実施要領

(目的)

第1条 この要領は、石川県工業試験場（以下「工業試験場」という。）が実施する研究開発課題に申請し、選定された相手方（以下「参画研究者」という。）と工業試験場が、研究開発段階から技術連携し、参画研究者のノウハウ、資金等を活用することにより、共同して研究開発の実用性を高め、製品化・事業化を促進する研究開発（以下「参画型研究」という。）に関して、必要な事項を定めるものとする。

(参画型研究の申請要件)

第2条 参画型研究を行おうとする参画研究者の本社、支社、生産施設又は実験施設等は県内に立地しなければならない。

(参画型研究の実施要件)

第3条 参画型研究は、次に掲げる要件を満たす場合に実施することができる。

- (1) 工業試験場が実施する研究事業の推進に効率的であり、かつ、参画研究者による研究成果の製品化あるいは事業化が期待されること。
- (2) 工業試験場の他の業務に重大な支障を及ぼすおそれがないこと。

(参画型研究の申請)

第4条 参画型研究を行うには、工業試験場長（以下「場長」という。）に別記様式1の企業参画型研究開発申請書を提出しなければならない。

(参画型研究契約の締結)

第5条 場長は、前条の企業参画型研究開発申請書の提出があったときは、第2条各号に掲げる要件への適合及び参画型研究の内容等を審査し、適当であると認めるときは、当該申請者と研究契約書による契約（以下「参画型研究契約」という。）を締結するものとする。

2 参画型研究契約書には、次の事項を記載しなければならない。

- (1) 研究課題
- (2) 研究目的
- (3) 研究内容及び目標
- (4) 研究の実施場所
- (5) 研究の実施期間
- (6) 研究の管理及び分担
- (7) 研究に参加する研究員の職・氏名
- (8) 研究に要する費用の分担
- (9) 第6条から第16条までに規定する事項
- (10) その他参画型研究を行うために必要な事項

3 前二項に関わらず、参画型研究の連携体に国等の公的研究機関、大学等（以下、「外部機関」という。）が含まれる場合は、外部機関の規程に基づく様式による契約を締結することができるものとする。

(研究員の派遣)

第6条 参画研究者は、場長の同意を得て、参画型研究を実施するため、参画研究者に属する研究員を工業試験場に派遣できるものとする。

2 研究員は、研究期間中、試験場において自己の責任による場合はもちろん、不可抗力による不慮の災害を被ったときは、研究員及び研究員の所属する企業、団体等の責任において解決するものとし、工業試験場に異議の申し立て並びに医療費等の請求については、一切これをできないものとする。

3 研究員が工業試験場の設備等に損害を与えた場合は、研究員及び研究員の所属する企

業、団体等の責任において、これを弁償しなければならない。

(研究の管理)

第7条 場長は、参画研究者と共同して研究の管理を行い参画型研究の効率的推進を図るものとする。

(研究費の納付等)

第8条 参画研究者は、参画型研究契約の締結後、遅滞なく契約書で定める参画研究者の負担に係る研究費の概算額を県に納入しなければならない。

(参画型研究計画の変更・中止)

第9条 場長は、工業試験場の業務に支障があるとき、又は天災その他やむを得ない事由により、参画型研究を継続することが困難となったときは、当該参画型研究を中止することができる。

2 場長は、前項の規定により参画型研究を中止したときは、遅滞なく参画研究者にその旨通知するものとする。

(特許出願)

第10条 参画型研究の結果、共同で行った発明について特許出願するときは、参画研究者と共同出願契約を締結し、共同で出願（以下「共同出願」という。）するものとする。ただし、参画研究者が特許権等の自己の持分を石川県に譲渡した場合は、この限りでない。

2 参画型研究の結果、工業試験場の研究員又は参画研究者の研究員が独自に行った発明について、県又は参画研究者が特許出願するときは、あらかじめ相手方の同意を得るものとする。

(研究結果の報告)

第11条 場長は、参画型研究を終了し、又は中止したときは、遅滞なくその参画型研究結果を集約し、参画研究者に通知するものとする。

(研究成果の帰属)

第12条 参画型研究結果で生じた成果品の帰属は、工業試験場と参画研究者が協議の上、定めるものとする。

(研究成果の公表)

第13条 場長は、参画型研究契約で別段の定めをした場合を除き、参画型研究の実施期間終了後、研究成果を公表できるものとする。

(守秘義務)

第14条 場長及び参画研究者は、研究の遂行上必要となる相手側の保有する技術上の情報、参画型研究の内容及び研究から得た知見のうち、場長及び参画研究者がその秘密を守るよう申し入れたものについては、その秘密を守らなければならない。

(設備の持込み等)

第15条 参画研究者は、場長の同意を得て、参画型研究を行うために必要な設備等を工業試験場へ持ち込むことができる。

2 参画研究者は、参画型研究終了後、場長の指示に従い、前項により持ち込んだ設備を工業試験場から撤去しなければならない。

(研究費の精算)

第16条 場長は、参画型研究を終了し又は中止したときは、第8条の規定により納入された研究費の精算を遅滞なく行うものとする。

(協議)

第17条 場長は、この要領に定めのない事項について参画研究者と協議して定めることができる。

附 則

- この要領は、平成17年5月1日から施行する。
- この要領は、平成21年4月1日から施行する。
- この要領は、平成26年4月1日から施行する。
- この要領は、平成29年4月1日から施行する。
- この要領は、平成31年4月1日から施行する。
- この要領は、令和元年5月1日から施行する。
- この要領は、令和3年3月1日から施行する。